



Microscopie électronique: EDS

Bases de l'EDX/EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)

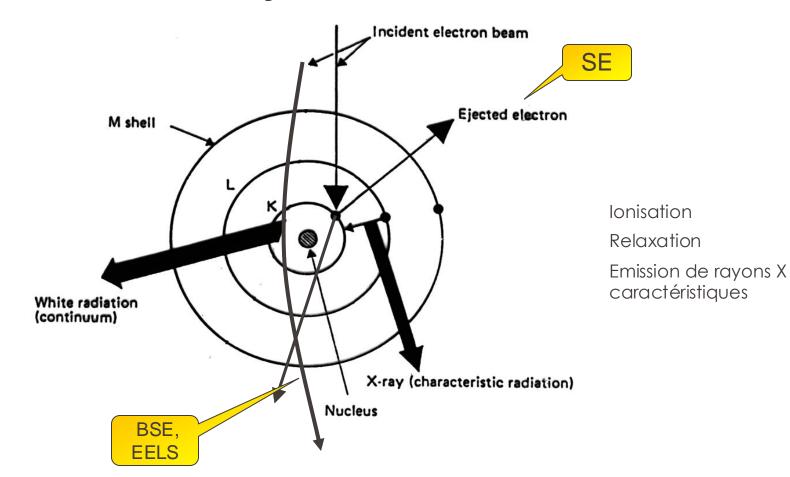
En français: Analyse dispersive en énergie des RX

- Création de rayons X
- Détection de rayons X
 - Détecteur Si(Li)
 - Détecteur Silicon Drift (SDD)
- Quantification
 - EDS dans un SEM, volume d'interaction, simulations Monte-Carlo
 - EDS dans un TEM
- Exemples

Aicroscopie électronique: ED8

Aïcha Hessler-Wyser

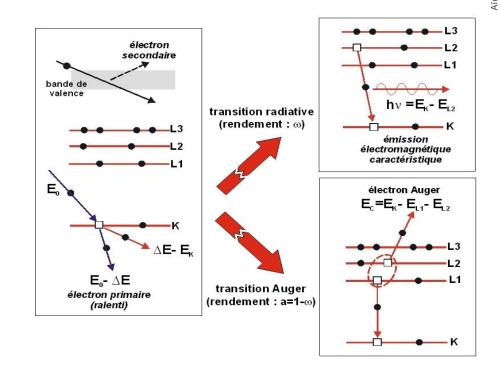
Création des Rayons X



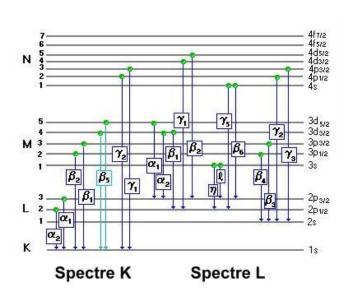


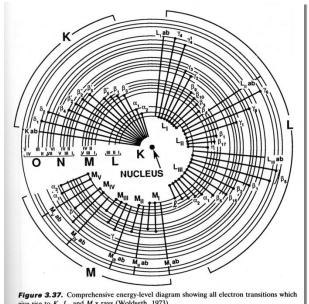
Rayonnement caractéristique

- Emission de RX caractéristique
- Emission d'électrons Auger



Rayonnement caractéristique

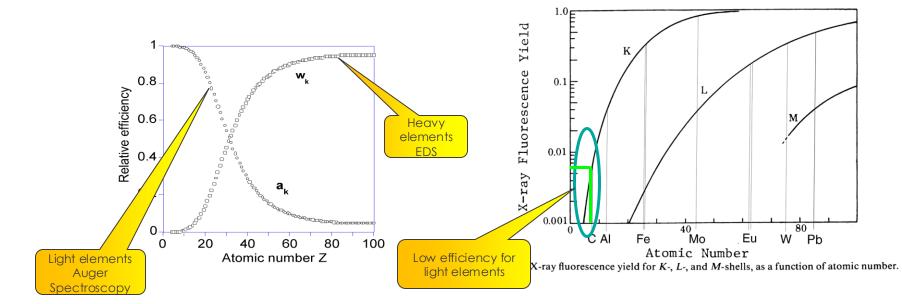




give rise to K, L, and M x rays (Woldseth, 1973).

Microscopie électronique: EDS

Les atomes d'éléments légers reviennent à leur état fondamental principalement par émission Auger. Taux de génération de RX en fonction du numéro atomique Z.

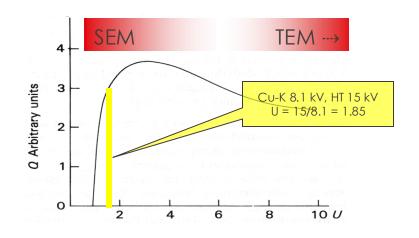


Efficacité d'ionisation

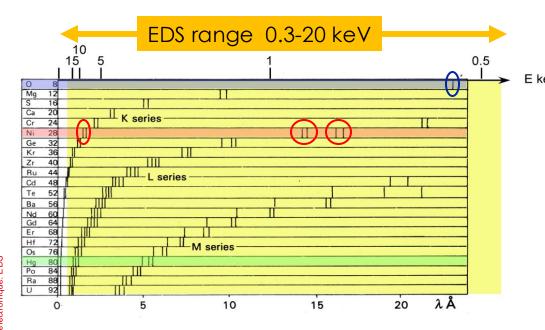
ıcna Hessier-wyse

Section efficace d'ionisation en fonction de la surtension $U = E_0/E_{edge}$

Pour ioniser un atome, l'électron incident DOIT avoir une énergie supérieure au niveau d'énergie profond (U > 1). Pour une efficacité optimale, il faut environ 2 fois l'énergie de seuil (U > 2).

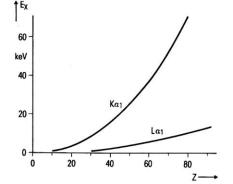


 $v = 2.4810^{15} (Z - 1)^2$



E keV L'énergie est donc E = h v et $\lambda = c/v$

avec la constante de Plank: $h = 6.62606876(52) \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \text{ et la}$ conversion 1 eV = 1.6 10⁻¹⁹ J



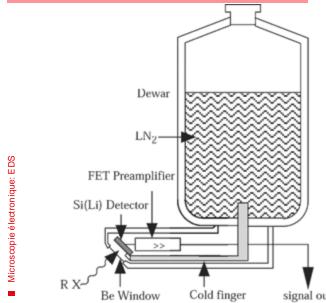
Pour identifier un élément, **toutes** ses raies doivent être détectées. Ambiguités connues: Al K_{α} = Br L_1 , S K_{α} = Mo L_1

Aïcha Hessler-Wyse

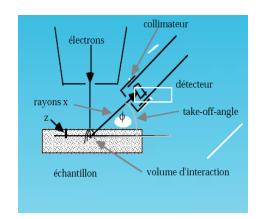
Détection des RX: détecteur Si(Li)

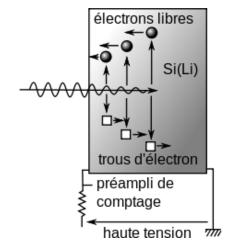
Création de paires électrons-trous dans du Si dopé au Li Migration sous l'effet du champ électrique de polarisation Courant de sortie proportionnel à l'énergie du RX incident

Attention, ne pas oublier la fenêtre!





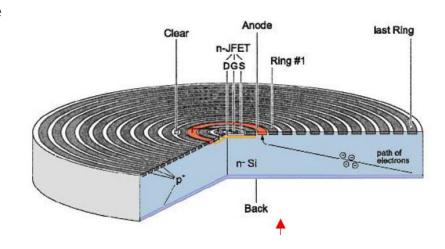




Détection des RX: détecteur à dérive au Si (SDD)

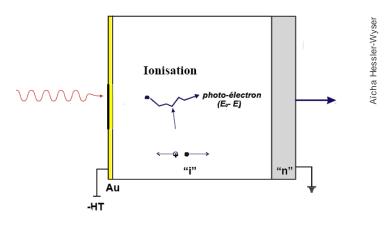
sna Hessier-wy

- Champ progressif qui permet aux électrons de drifter vers l'électrode centrale
- Le refroidissement de l'électrode réduit le bruit
- Pas besoin de refroidissement à l'azote liquide, mais par un élément Pelletier
- Permet un plus grand taux de détection sans saturation

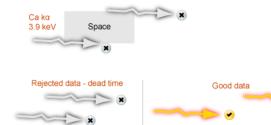


Détection des rayons X

- Conversion de Rayons X en charge électrique: 3.8 eV /paire électron-trou en moyenne
- Bruit électronique + collection de charges imparfaite: 80-180 eV de résolution (référence sur la raie Kα du Mn)
- Temps de processing: temps d'analyse de l'énergie du RX
- Temps mort: temps pendant lequel les RX incidents ne sont pas comptés



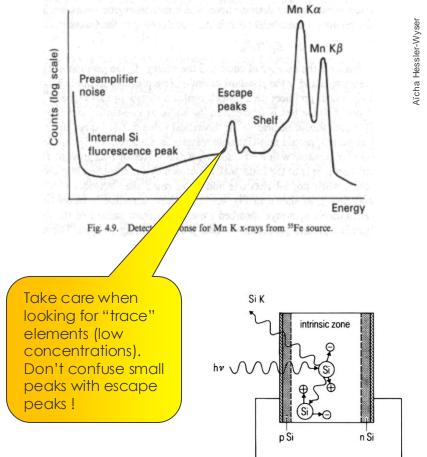
X-ray count rate and dead time



Spectre et artefacts

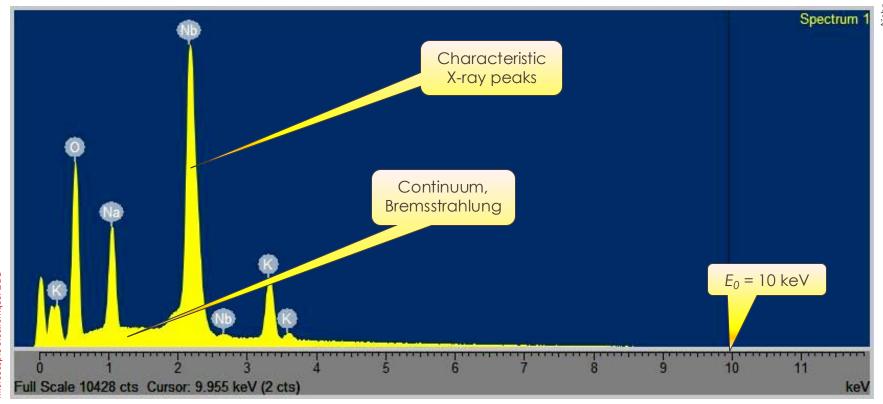
• Escape and fluorescence peaks: les RX d'une certaine énergie interagissent avec le Si du détecteur (fluorescence) et ont une énergie plus basse de 1.7 keV

 Pile-up peaks: quand le signal est très intense, il peut y avoir deux RX de même énergie qui sont considérés come un RX d'une énergie double



 $\simeq -1000 \text{ V}$

Spectre EDS

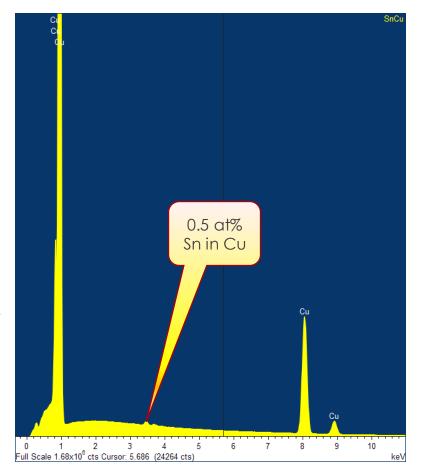


Microscopie électronique: EDS

Aïcha Hessler-Wysel

Limite de détection par EDS en SEM

- Acquisition dans les meilleures conditions
 - Surface plane sans contamination (pas de coating Au, préférer C)
 - Echantillon homogène à l'endroit analysé (▲ volume d'interaction)
 - Orientation horizontale de la surface
 - Haut taux de comptage
 - **Surtension** $U = E_0/E_c > 1.5-2$
 - Temps d'acquisition assez élevé pour une bonne statistique
- Limite de détection ≈0.5 at% pour la plupart des éléments



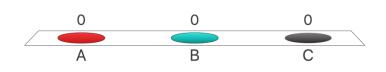


Pourquoi la raie K du Si est à 1.7 keV alors que l'énergie de création de paires électrons-trous est de 3.8 eV?

- A. Parce qu'il faut ioniser le détecteur
- B. Car c'est l'énergie nécessaire pour générer un courant dans le détecteur
- C. Car c'est l'énergie d'ionisation de l'échantillon en Si

Sondage: responseware.eu

ID: intromicro



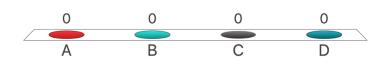
EPFL

Pourquoi le pic d'échappement du détecteur est à 1.7 keV sous le pic principal?

- A. Car c'est l'énergie de gap du Si
- B. Car c'est l'énergie de la raie K du Si
- C. Car c'est l'énergie de la raie K du Be (fenêtre du détecteur)
- D. C'est un hasard

Sondage: responseware.eu

ID: intromicro



Quantification

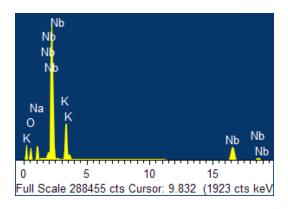
- Première approche: comparer l'intensité des RX avec un standard
- Il faut un échantillon de référence avec une concentration connue exactement
- Les conditions d'observations doivent être identiques pour l'échantillon de référence et l'échantillon mesuré
 - C_i: concentration de l'élément i
 - *l_i*: intensité de la raie caractéristique

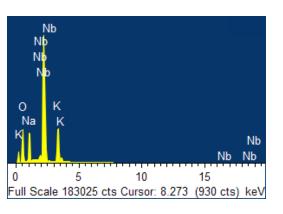
 $\frac{c_i}{c_i^{std}} = \frac{I_i}{I_i^{std}} = k_i$

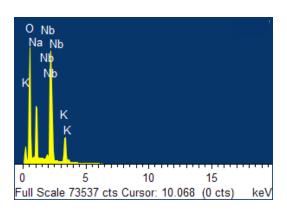
k_i: rapport des concentrations

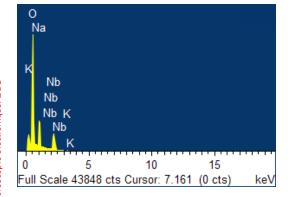
Aïcha Hessler-Wyser

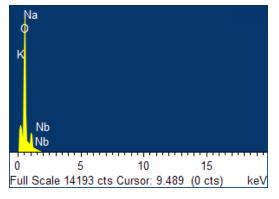
Quantification: intensité = concentration?









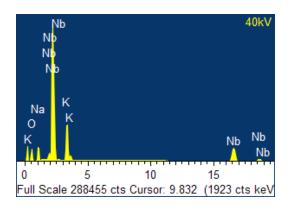


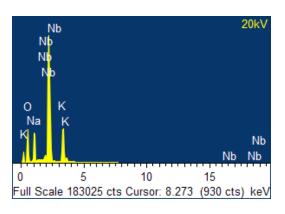
Plusieurs échantillon différents?

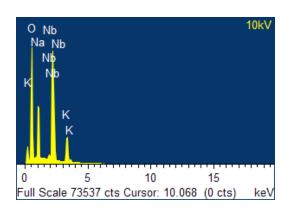
Microscopie électronique: EDS

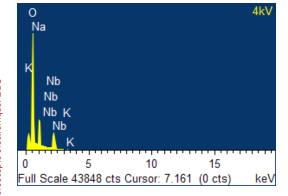
Aïcha Hessler-Wyser

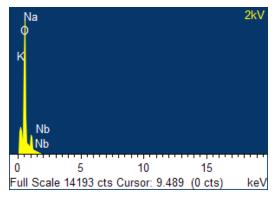
Quantification: intensité ≠ concentration!







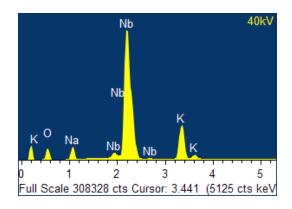


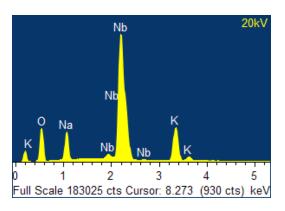


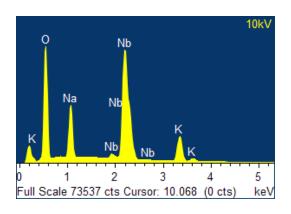
Même échantillon

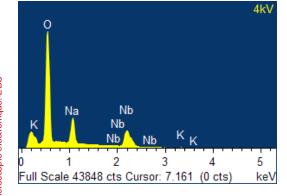
Conditions différentes

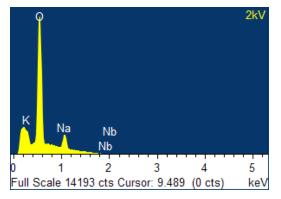
Quantification: intensité ≠ concentration!









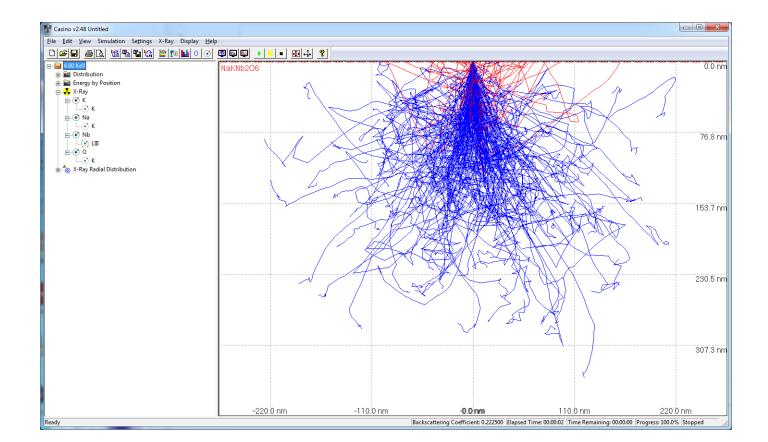


Même échantillon

Conditions différentes

EPFL

Simulations Monte-Carlo avec CASINO

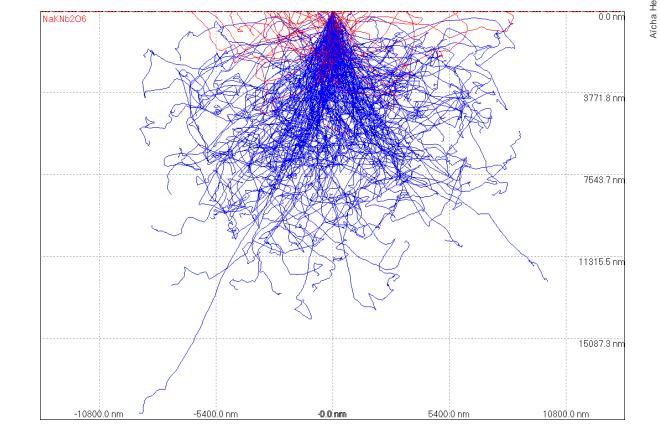


Simulations Monte-Carlo avec CASINO

40 kV

Nb K α : 16.6 keV Nb L α : 2.16 keV O K α : 525 eV

Chaque raie est absorbée différemment!!

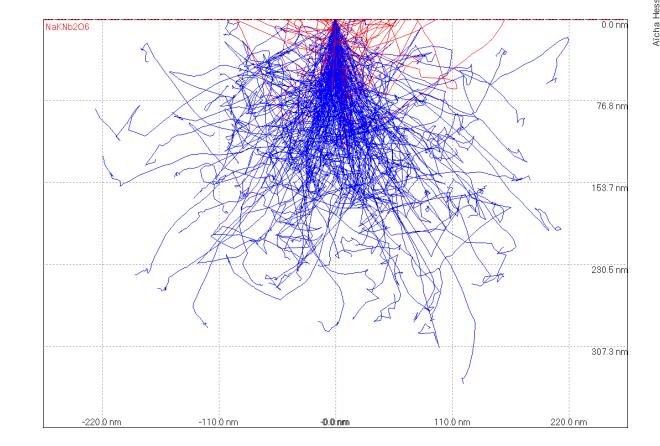


Simulations Monte-Carlo avec CASINO

4 kV

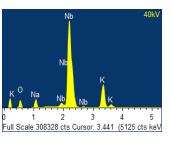
Nb Kα: 16.6 keV Nb Lα: 2.16 keV O Kα: 525 eV

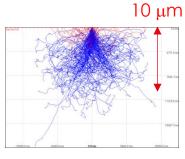
Toutes les raies de l'oxygène peuvent sortir!!

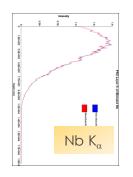


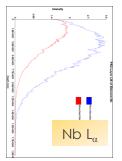
Simulations Monte-Carlo avec CASINO

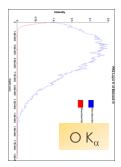
vicha Hessler-Wys



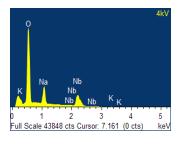


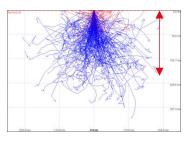


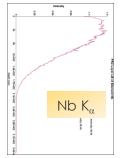


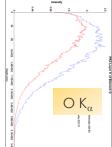


200 nm









Réabsorption de l'oxygène et des L_{α} du Nb pour les grand volumes d'interaction

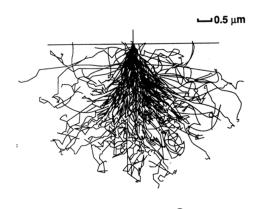


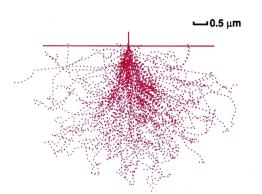
Il faut introduire des corrections!

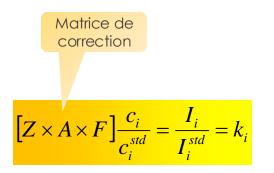
Quantification: différentes méthodes

- ZAF: purement théorique
- PROZA Phi-Rho-Z
- PaP (Pouchou and Pichoir)
- XPP (extended Pouchou and Pichoir)
 - Avec standards: il faut les mêmes conditions (tension, courant, réglage des détecteurs) de mesure
 - · Sans standards: calcul théorique de l'intensité
 - Sans standard optimisé: l'utilisateur définit des profils de pics comme des sortes de standards

Quantification: ZAF

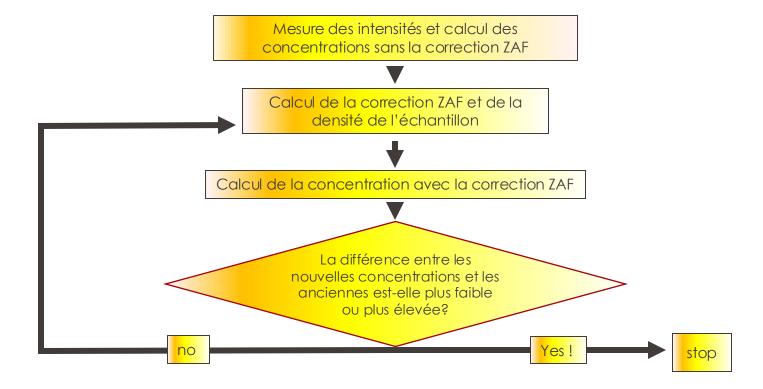






- Z décrit comment le faisceau d'électrons pénètre dans l'échantillon et perd de l'énergie (dépend du numéro atomique et de la densité de l'échantillon)
- A décrit l'absorption des RX générés lorsqu'ils ressortent de l'échantillon
- F décrit la fluorescence générée par les RX

Quantification: procédure



Aicha Hessler-Wyser

Quantification dans un SEM

- Choisir les meilleures conditions pour l'acquisition:
 - Surface plane sans contamination, orientée horizontalement
 - Echantillon homogène à l'endroit de la mesure
 - Haut taux de comptage, mais temps mort < 30%
 - Surtension 1.5-2 fois l'énergie des raies X des éléments cherchés
- Quantification sans standard
 - Possible avec une haute précision, mais il faut tester sur des échantillons de composition connue
 - · La quantification des éléments légers est critique
 - La résolution spatiale dépend fortement de la tension d'accélération (HT) et de la densité de l'échantillon

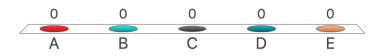


Pourquoi faut-il introduire des facteurs de correction?

Sondage: responseware.eu

ID: intromicro

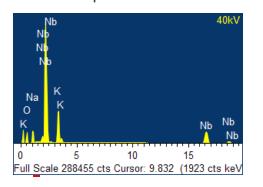
- A. Pour corriger les erreurs sur la mesure de l'énergie des RX
- B. Pour corriger les pile-up peaks
- C. Pour corriger les aberrations des lentilles du microscope
- D. Pour corriger la réabsorption des rayons X dans l'échantillon
- E. Pour corriger la réabsorption des rayons X dans le détecteur

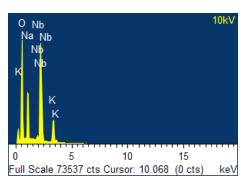


EPFL

Est-ce que les différences de spectres peuvent suggérer une inhomogénéité de l'échantillon si l'on ne fait pas les corrections?

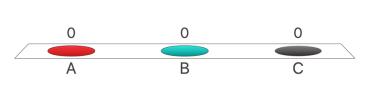
- A. Non, il ne peut s'agir que d'une différence de réabsorption, cela disparaît avec les corrections
- B. Oui, cela pourrait être une couche moins riche en O à la surface
- C. Oui, cela pourrait être une couche plus riche en O à la surface





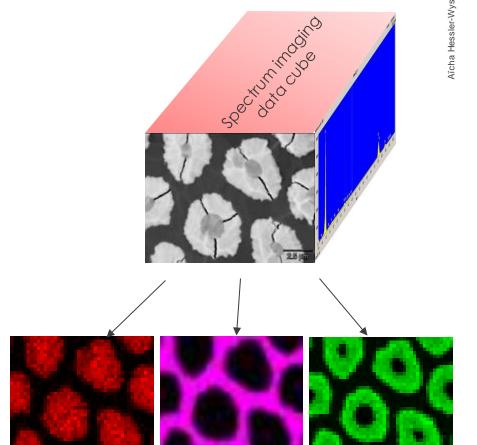


ID: intromicro



Cartographie EDS

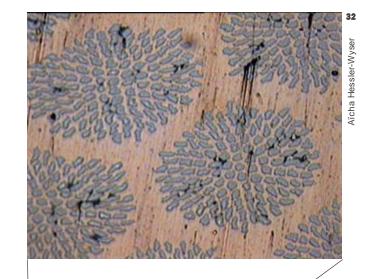
- Datacube
 - Un spectre complet est acquis pour chaque pixel de l'image
 - Les données sont enregistrées en 3D: x, y, E
- Traitement après l'acquisition
 - Chaque spectre peut être analysé et quantifié
 - Pour chaque pixel, on attribue une concentration en un élément
 - Cela représente des cartographies par élément



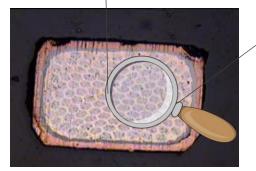
Câbles supraconducteurs: multifilament Nb₃Sn

- Câbles supraconducteurs en Nb₃Sn pour des champs magnétiques de 10 à 20 T
 - Courant plus élevé, moins cher
 - Applications potentielles: réacteur à fusion Tokamak, Hadron Collider (LHC, Cern)

NMR, Large

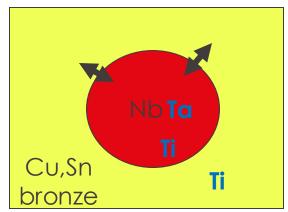


Câble type: 1 x 1.5 mm de coupe 121 x 121 filaments de Nb3Sn enrobés dans une matrice de bonze (Cu/Sn)



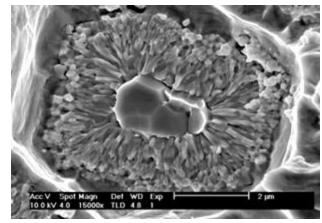
R. .Fluckiger et al, Dept Condensed Matter Physics, UniGe

Fabrication: la "route du bronze"



Nb₃Sn Cu,Sn Traitement thermique

On pense que le Cu et le Ti jouent un rôle important aux joints de grains (pinning)



SEM: reacted filament

- Est-ce que la phase Nb₃Sn est homogène?
- Est-il possible de déeteter le Cu et le Ti aux joints de grains ?

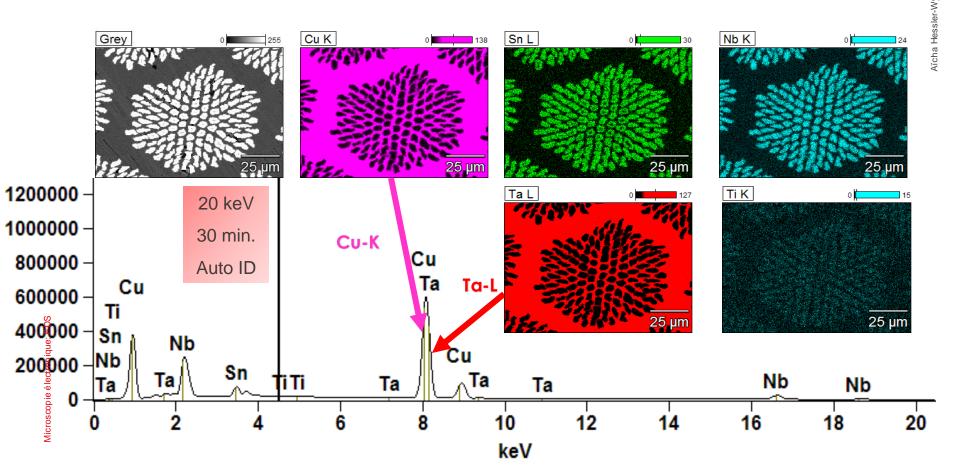
Acc.V Spot Magn

30.0 kV 4.0 80x

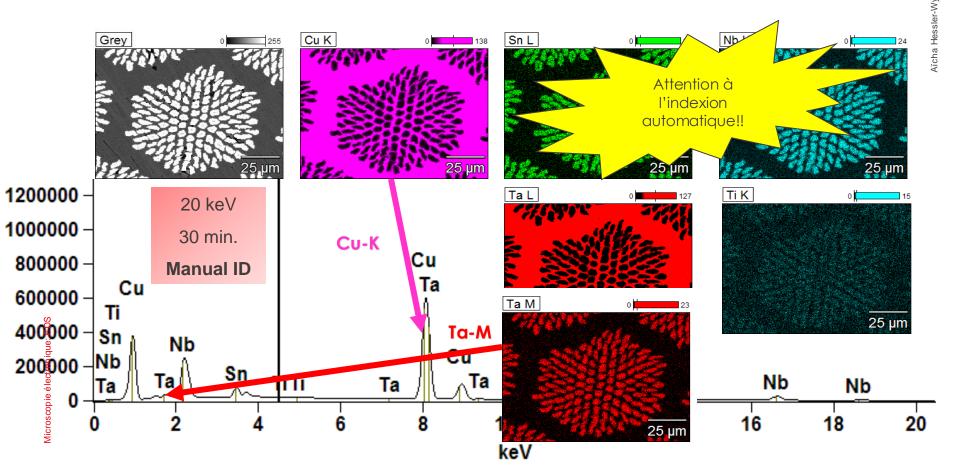
Det WD

BSE 10.2

Cartographie élémentaire : distribution qualitative



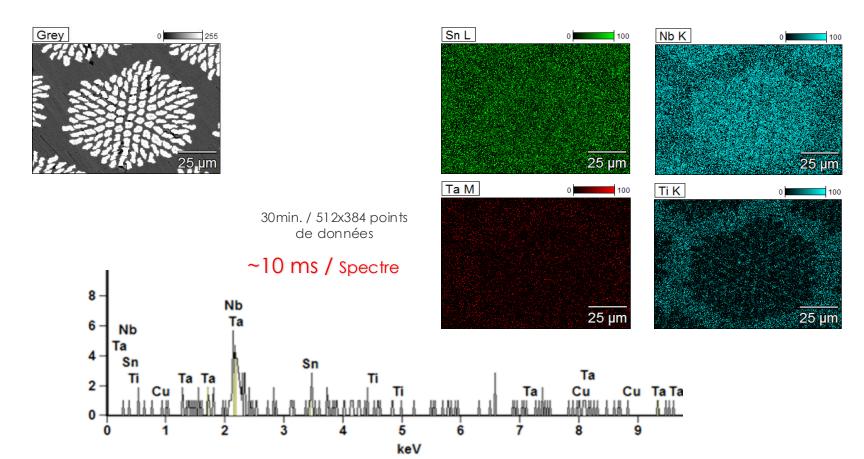
Cartographie élémentaire : distribution qualitative



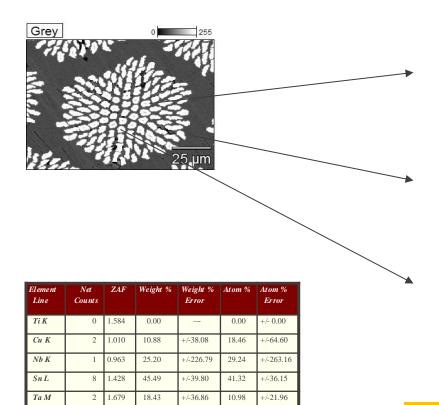
Microscopie électronique: EDS

Aïcha Hessler-Wyser

Cartographie élémentaire : quantification



Cartographie élémentaire : quantification



100.00

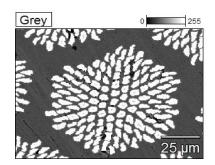
100.00

8 - Nb Ta Ta Ta Ta Ta Cu Cu Ta Ta Cu Cu Ta Ta Cu Cu Ta Ta keV
Ta Cu Ta Cu Sn Nb Ta Ta Ta Ti Ta Nb Sn Ti Ti Ti Ta Nb Ta T
Ta Nb Cu Ta Ta Sn Ti Ti Ta Cu Ta Ta Cu Ta Ta O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 keV

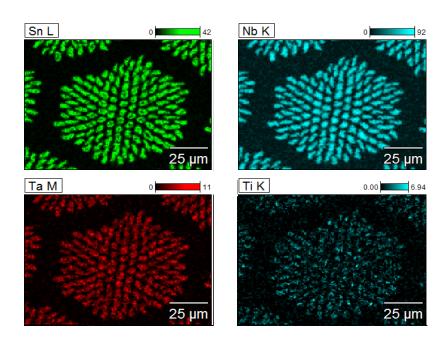
Est-ce vraiment de la "quantification"?

Total

Quantification: amélioration de la statistique



Element Line	Net Counts	ZAF	Weight %	Weight % Error	Atom %	Atom % Error
Ti K	36	1.584	2.14	+/- 0.95	4.42	+/- 1.97
Nb K	124	0.981	66.95	+/-30.24	71.27	+/-32.19
Sn L	305	1.722	25.87	+/- 3.48	21.56	+/- 2.90
Та М	57	1.351	5.04	+/- 2.21	2.75	+/- 1.21
Total			100.00		100.00	

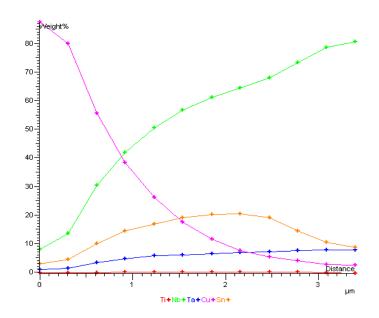


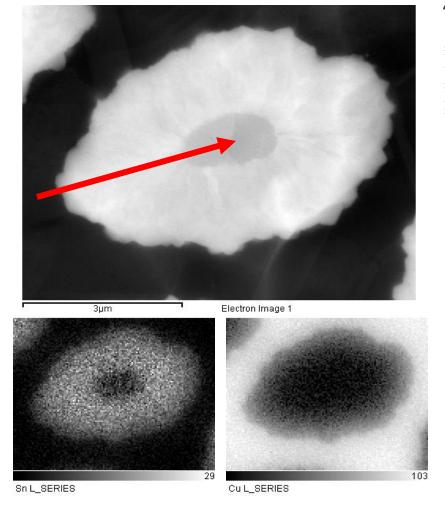
"Binning de 5x5 pixels": meilleure statistique

Moins d'erreur!

Aïcha Hessler-W

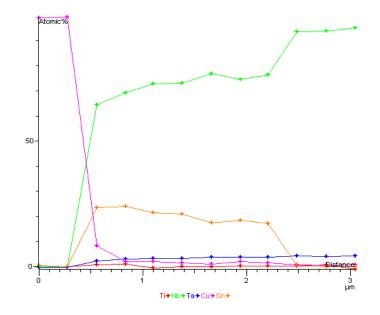
Résolution spatiale @ 30 kV

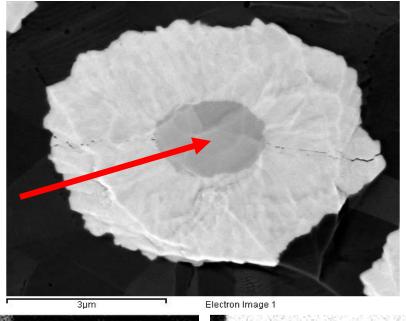


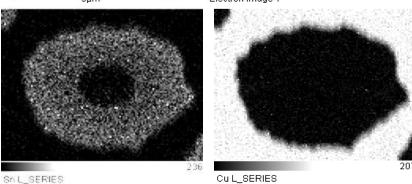


Microscopie électronique: EDS

Résolution spatiale @ 7 kV

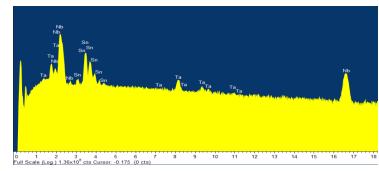


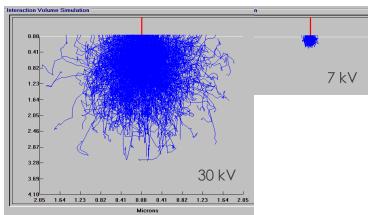


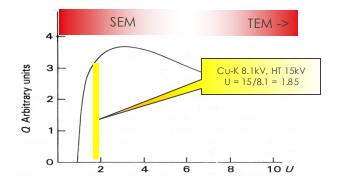




Tension et volume d'interaction







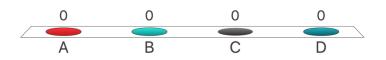
- Nb K_{α1} 16,6 keV
- Nb L_{α1} 2.14 keV
- Ta L_{α1} 8.14 keV
- Ta M_{α1} 1.71 keV
- Cu K_{α1} 8.1 keV
- Cu L_{α1} 0.93 keV
- Sn K_{α1} 25.2 keV
- Sn L_{α1} 3.44 keV

Pour ioniser les atomes de l'échantillon, les électrons incidents DOIVENT avoir une énergie supérieure au niveau des couches internes U>1. Pour que cela soit efficace, il faut avoir environ deux fois le seuil d'énergie d'inonisation U>2.



Qu'est-ce qu'un data cube en EDS?

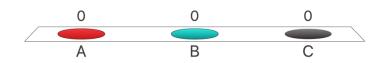
- A. Des spectres acquis pour chaque pixel d'image
- B. Des images acquises pour chaque énergie de RX
- C. Une image colorée pour chaque élément





Dans un spectre EDS, quelle est la résolution la plus importante?

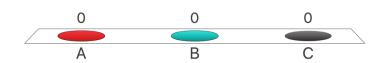
- A. La résolution spatiale
- B. La résolution en énergie
- C. Les deux



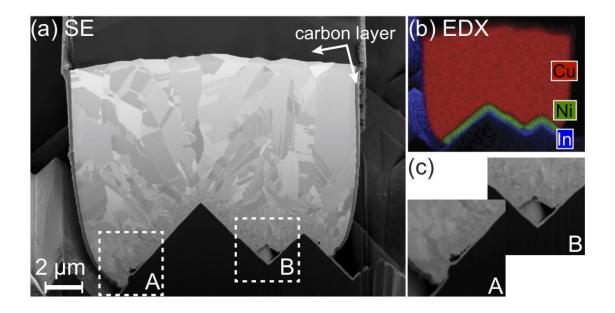


Lors d'une cartographie EDS, quelle est la résolution la plus importante?

- A. La résolution spatiale
- B. La résolution en énergie
- C. Les deux

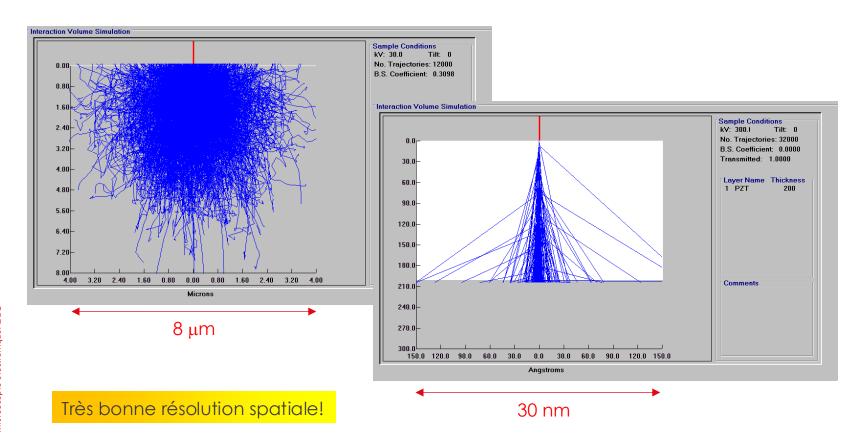


Métallisation d'une cellule solaire par plating



Il faut un petit volume d'interaction pour voir les couches de 150 nm

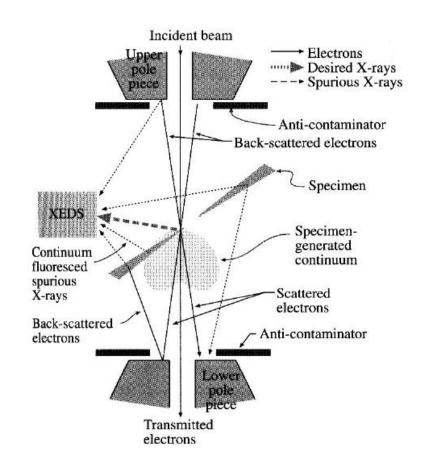
EDS dans un TEM



EDS dans un TEM

- Echantillon mince
 - Facteurs de correction très faibles (A et F peuvent être négligés)
- Très faible dispersion du faisceau incident
 - Haute résolution spatiale
 - De l'ordre de grandeur de la taille du faisceau: ≈nm

Haute énergie: Artefacts!!

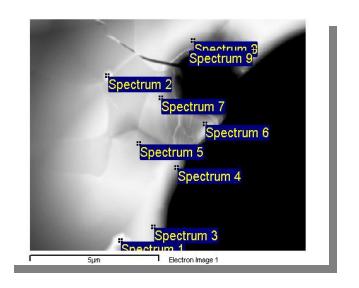


EDS dans un TEM

Processing option : Oxygen by stoichiometry (Normalised)

Spectrum	Mg	Si	Nb	Pb	0	Total
Spectrum 1	30.02	13.32			56.66	100.00
Spectrum 2	19.15	7.96	4.11	11.72	57.06	100.00
Spectrum 3 Spectrum 4	6.01 5.65		12.49 12.39	22.13	59.37 59.29	100.00 100.00
Spectrum 5	5.63		12.48	22.52	59.36	100.00
Spectrum 6	5.98		13.66	20.11	60.25	100.00
Spectrum 7	5.55		12.45	22.66	59.34	100.00
Spectrum 8	5.49 5.63		12.96 12.19	21.84 23.04	59.72 59.14	100.00 100.00
Spectrum 9	5.03		12.19	23.04	39.14	100.00
Max.	30.02	13.32	13.66	23.04	60.25	
Min.	5.49	7.96	4.11	11.72	56.66	

All results in Atomic Percent

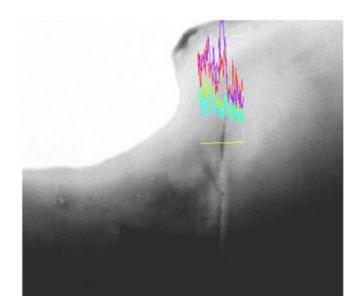


 $PbMg_{1/3}Nb_{2/3}O_3$ (bulk)

Microscopie électronique: EDS

La concentration mesurée n'est pas uniforme!

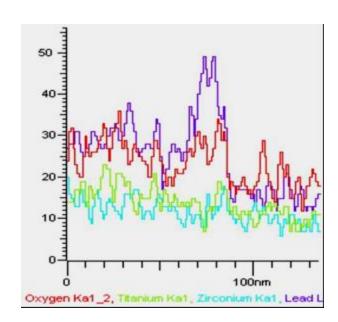
STEM linescan



Electron Image 1

500nm

Pb(Zr,Ti)O₃



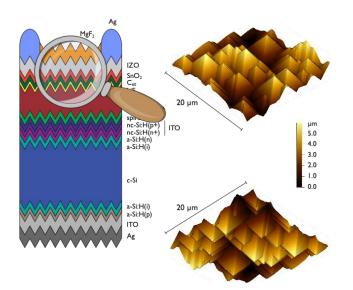
Variation d'épaisseur: résultats inhomogènes

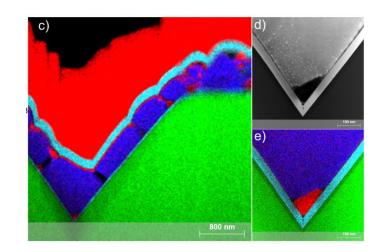
Ségrégation aux joints de grain!

Cellule photovoltaïqe tandem PK/Si

Problèmes de conformalité!

- Les perovskites (PK) sont fabriquées à l'aide d'un précurseur liquide
- Incompatible avec la texture pyramidale de la cellule silicium
- La texture est nécessaire pour un management de lumière optimal

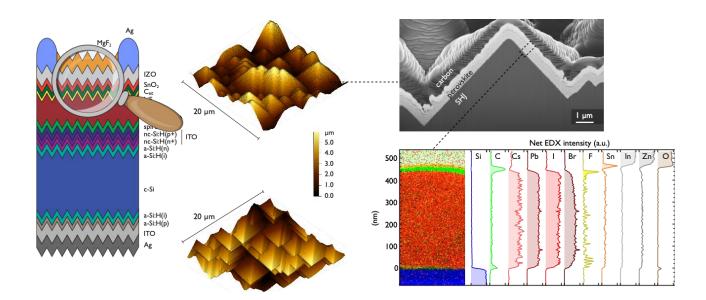




Cellule photovoltaïqe tandem PK/Si

EDS permet de voir les couches d'interface!

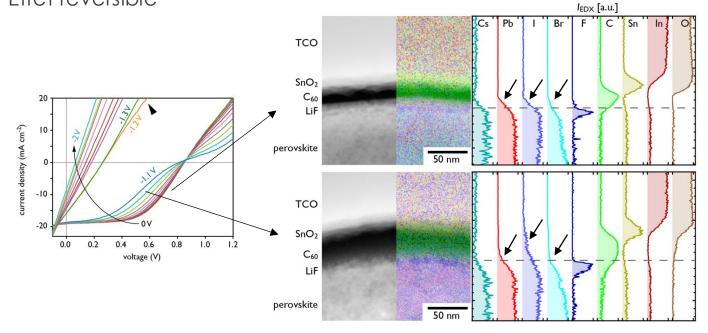
- Les perovskites (PK) sont fabriquées à l'aire d'un précurseur liquide
- Incompatible avec la texture pyramidale de la cellule silicium
- La texture est nécessaire pour un management de lumière optimal



Cellule photovoltaïqe tandem PK/Si

EDS permet de voir les couches d'interface!

- Migration du I lors de l'inversion de la tension
- Effet réversible



- D'où viennent les RX? Quelle condition d'utilisation?
- Quelle info portent-ils?
- Comment les détecter?
- Qu'est-ce qu'un spectre?
- Quelle info peut-on trouver sur un spectre, à quoi faut-il faire attention?
- Quantification
- Qu'est-ce qu'une carte EDX?
- Résolution spatiale

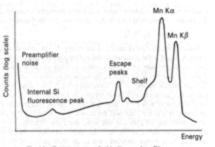


Fig. 4.9. Detector response for Mn K x-rays from "Fe source.

